

2019年7月10日（水）

TIA-NEG キックオフミーティング開催のご案内

令和元年度 TIA 連携プログラム調査研究課題「非蒸発型ゲッターコーティングによる真空技術の革新」は、下記のとおり、キックオフミーティングを行います。関係分野の方々に広くご参加いただきたく、案内させていただきます。

研究代表者 間瀬一彦／KEK

日時：2019年7月16日（火） 13:30～17:00

場所：NIMS 千現 研究本館 第1会議室

交通アクセス http://www.nims.go.jp/nims/office/tsukuba_sengen.html

※ ご来構時は、次ページの「面会票」にお名前・ご所属・ご連絡先を記入の上、印刷して守衛所にお持ちください。その際、免許証等のご提示もお願いいたします。

参加費：無料（事前登録にご協力ください）

プログラム：（敬称略）

13:00～ 受付

13:30～14:10 趣旨説明と KEK での研究計画紹介（間瀬）

14:10～14:30 産総研での研究計画紹介（新井）

14:30～14:50 話題提供「イオンビームを用いた軽元素分析」（杉澤）

14:50～15:10 NIMS での研究計画紹介（橋本）

15:10～15:25 休憩

15:25～15:45 東大での研究報告（吉川）

15:45～16:15 話題提供「先進イナート表面への挑戦：

極低活性・極低反応性表面を実現する材料／処理技術の探索とその計測技術」（板倉）

16:15～17:00 総合討論

17:30～19:30 交流会@ワインとピザ ビストロ ポリッツァ

https://r.gnavi.co.jp/plan/pse3zxak0000/plan-reserve/plan/plan_list/:c10/

（会費 4,000 円）

会場の都合上、7月8日（月）までにご連絡いただければ幸いです。

その際、交流会にもご参加いただけるかどうかもお知らせください。

参加登録および問い合わせ先： INAISHI.Kaname@nims.go.jp（物質・材料研究機構 稲石）までご連絡ください。

面会票 1

Visitor Registration Form 1

※二重線内を記載いただき、来構時守衛所に提出願います。

※Please fill in the double lined frame and submit this to the guard's office when entering.

		通 し 番 号 Serial Number	
入 門 時 間 Entering Time	:	出 門 時 間 Leaving Time	:
入 構 許 可 証 番 号 Admittance Number		通 行 ・ 駐 車 許 可 証 番 号 Parking Permit Number	
年 月 日 Date	令和 元年 7月 16日 (火)		
管 理 区 域 Visiting Area	A (研究本館)		
氏 名 Name			
緊 急 連 絡 先 Emergency Contact Number			
会 社 名 等 Company Name			
行 先 部 課 名 1 Destination 1	課 室 名 Division	表界面物理計測グループ	
	担 当 者 Contact Person	板倉 明子	
	来 構 場 所 Venue	研究本館 1F 第 1 会議室	
車 両 番 号 Car Plate Number			
来 構 目 的 Reason for Visit	TIA 連携プログラム調査研究キックオフミーティング		
そ の 他 Others			